

分析機器部門講習会シリーズ

集束イオンビーム走査電子顕微鏡 (FIB/SEM) 講習会のお知らせ

新しく設置しました試料作製の集束イオンビームとマイクロ分析の走査電子顕微鏡を組み合わせたDualBeam装置、Sciosの基本操作を説明します。

日時：平成27年 2月18日(水) 9:30~12:00(アライメント関係)
13:00~17:00(FIB加工関係)

使用機器：Scios

受講対象：Sciosを使用予定の方

講習内容：基本操作

場所：医工連携研究室（研究棟3号館 5階 医工連携研究室）

定員：約6名

申込期間：平成27年2月16日（月）12時まで

申込方法：電子メールで、「講習会名（FIB/SEM講習会）」「希望日」
「所属講座名」「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」
を明記の上、k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp宛にお申込ください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：板倉（内線：5792 Email：k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp）

※Webでも講習会情報を掲載しています（<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>）